PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-049920

(43) Date of publication of application: 18.02.1997

(51)Int.Cl.

G02B 5/20

B41J 2/05

G02F 1/1335

(21)Application number: 07-218270

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

04.08.1995

(72)Inventor: SAKINO SHIGEO

HORIKOSHI YASUO

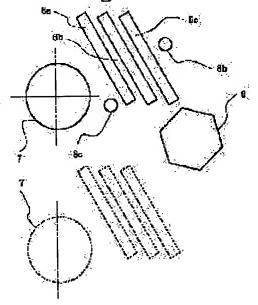
IINO MASAYUKI

(54) APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING COLOR FILTER AND COLOR FILTER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To inexpensively produce a color filter having good characteristics such as resolution with good reliability, by easily aligning the hit positions of ink jets of three colors with good accuracy.

SOLUTION: This apparatus for producing the color filter includes at least one set of plotting heads 6a to 6c which respectively discharge the ink jets of the three colors, R, B, B, a moving means for mounting and moving a substrate having the color filters formed by the plotting with the ink jet and an aligning means for aligning the substrate mounted at the moving means and the plotting heads 6a to 6c. The plotting heads 6a to 6c of the three colors are previously mounted at a head mounting jig and are relatively aligned. After the plotting heads are mounted together with the head mounting jigs at the device, a dummy substrate is mounted at the moving means and the height and tilt of the head mounting jigs



relative to this dummy substrate are so adjusted that the spacings between the dummy substrate and the respective plotting heads attain prescribed values.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

, ,

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-49920

(43)公開日 平成9年(1997)2月18日

(51) Int.Cl. ⁶		微別記号	庁内整理番号	ΡI	技術表示箇所				
G02B	5/20	101		G 0 2 B	5/20	101			
B41J	2/05			G 0 2 F	1/1335	505			
G 0 2 F	1/1335 5 0 5			B 4 1 J	3/04	3/04 1 0 3 B			
				審查請求	永龍朱 第	請求項の数 6	FD	(全 6 頁)	
(21)出顧番号	,	特顯平7-218270			(71)出顧人 000001007 キヤノン株式会社				
(22)出顧日	出顧日 平成7年(1995)8月4日 東京都大田区下丸子3丁 (72)発明者 崎野 茂夫 東京都大田区下丸子3丁								

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ ン株式会社内

(72)発明者 堀越 康夫

ン株式会社内

(72)発明者 飯野 正行

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

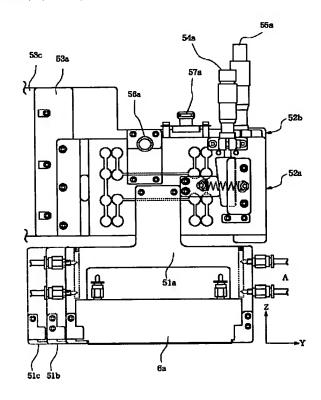
(74)代理人 弁理士 伊東 哲也 (外1名)

(54) 【発明の名称】 カラーフィルタ製造装置および方法ならびにカラーフィルタ

(57)【要約】

【課題】 3色のインクジェットの着弾位置を容易かつ 高精度に位置合わせし、解像性等の特性が良好なカラー フィルタを安価に信頼性よく製造する。

【解決手段】 R, G, B3色のインクジェットをそれぞれ吐出する少なくとも1組の描画ヘッドと、前記インクジェットによる描画によってカラーフィルタが形成される基板を搭載して移動する移動手段と、前記移動手段に搭載された基板と描画ヘッドを位置合わせする位置合わせ手段とを具備するカラーフィルタ製造装置において、前記3色の描画ヘッドは予めヘッド取付治具に取り付けて相対位置合わせしておき、ヘッド取付治具に取り付けて相対位置合わせしておき、ヘッド取付治具ごと装置に搭載した後、ダミー基板を前記移動手段に搭載し、ダミー基板と各描画ヘッドとの隙間が所定値となるようにダミー基板に対するヘッド取付治具の高さおよびチルトを調整する。



I

【請求項1】 R, G, B3色のインクジェットをそれ ぞれ吐出する少なくとも1組の描画ヘッドと、

前記3色の描画ヘッドが取り付けられそれらのインクジェット吐出面および吐出口を相対位置合わせして固定されたヘッド取付治具と、

該ヘッド取付治具を搭載する手段と、

【特許請求の範囲】

前記インクジェットによる描画によってカラーフィルタ が形成される基板を搭載して移動する移動手段と、

前記移動手段に搭載された基板と前記3色の描画へッド との間隔を描画へッドの位置に関して異なる少なくとも 3か所で検出するギャップセンサと、

前記インクジェットによる基準描画面に対して該ヘッド取付治具の高さおよび傾きを調整する手段と、

前記移動手段に搭載された基板と描画ヘッドを位置合わせする位置合わせ手段とを具備することを特徴とするカラーフィルタ製造装置。

【請求項2】 前記位置合わせ手段は、前記基板と描画 ヘッド間の相対変位を検出する変位検出手段と前記描画 ヘッドから吐出されたインクジェットの前記基板上における着弾位置を検出する手段とを備え、前記着弾位置の検出結果および相対変位の検出結果に基づいて前記基板 および描画ヘッド間の位置合わせを行なうことを特徴とする請求項1に記載のカラーフィルタ製造装置。

【請求項3】 前記基板と描画ヘッドの相対変位検出および位置合わせは6自由度方向のものであることを特徴とする請求項2に記載のカラーフィルタ製造装置。

【請求項4】 R, G, B3色のインクジェットをそれ ぞれ吐出する少なくとも1組の描画ヘッドと、これら3 色の描画ヘッドが取り付けられ、それらのインクジェッ ト吐出面および吐出口を相対位置合わせして固定されて いるヘッド取付治具と、前記インクジェットによる描画 によってカラーフィルタが形成される基板を搭載して移 動する移動手段と、前記基板と描画ヘッド間の位置合わ せを行なう位置合わせ手段とを具備するカラーフィルタ 製造装置を用い、前記基板を移動させながら前記描画へ ッドによって前記基板上に描画を行なうことによりカラ ーフィルタを形成する際、基板への描画に先立って、厚 みムラのないダミー基板を前記移動手段に搭載し、該ダ ミー基板と前記3色の描画ヘッドの間隔を描画ヘッドの 位置に関して異なる少なくとも3か所で測定しながら、 前記インクジェットによる基準描画面に対する前記ヘッ ド取付治具の高さおよび傾きを調整して前記隙間を所定 値に合わせることを特徴とするカラーフィルタの製造方

【請求項5】 前記請求項1~3のいずれかに記載の装置を用いて製造されたことを特徴とするカラーフィルタ。

法。

【請求項6】 前記請求項4に記載の方法により製造されたことを特徴とするカラーフィルタ。

2

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、カラーテレビ、パーソナルコンピュータ等に使用されるカラー液晶ディスプレイのカラーフィルタを製造する技術に関し、特にインクジェット記録技術を利用したものに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、カラーフィルタの製造方法として は、染色法、顔料分散法、電着法、印刷法等がある。

【0003】染色法とは、ガラス基板上に染色用の材料である水溶性の高分子材料の層を形成し、これをフォトリソグラフィにより所望のパターンに成形し、そしてこのガラス基板を染色漕に浸漬して着色されたパターンを得る工程をR,G,B3色につき3回繰り返すことによりカラーフィルタを形成するものである。

【0004】顔料分散法とは、ガラス基板上に顔料を分散した感光性樹脂層を形成し、これをパターニングすることにより単色のパターンを得る工程をR, G, B3色につき3回繰り返すことによりカラーフィルタを形成するものである。

【0005】電着法とは、ガラス基板上に透明電極パターンを形成し、このガラス基板を顔料、樹脂、電解液等の入った電着塗装液に浸漬して単色を電着させる工程をR,G,B3色につき3回繰り返し、そして焼成することによりカラーフィルタを形成するものである。

【0006】そして印刷法とは、熱硬化型の樹脂に顔料を分散させたものを用いた印刷を3回繰り返すことによりR,G,B各色を塗り分け、その後、樹脂を熱硬化させるものである。

30 【0007】この4種の方法に共通しているのは、R, G, B3色を着色するために同一工程を3回繰り返す必要があり、工程数が多いために、歩留が低下し、コストが高くなる、等の欠点を有するということである。

【0008】さらに、電着法は、形成可能なパターンの 形状が限定されるため、TFTへの適用が困難である。 また印刷法は、解像性が悪く、パターン微細化への対応 が困難である等の欠点を有する。

【0009】そこで、これらの欠点を補うべく、ガラス 基板上にインクジェットを吐出させてフィルタのパター ンを形成する技術が提案されている(特開昭59-75 205、特開昭63-235901、特開平1-217 320等)。

【0010】しかしながら、このインクジェットを用いる技術においては、生産を行なっていくための機能が不十分である。すなわち、インクの着弾位置を予め測定しておき、製造装置にガラス基板を装着する際にはガラス基板を描画ヘッドに対して(あるいは、描画ヘッドをガラス基板に対して)6自由度方向のアライメントを行ない、その後、描画ヘッドとガラス基板間の隙間を一定に50 保ちながら描画する、といったような機能がないため、

る。

3

高精度な描画を行なうことができない。また、生産性に ついても考慮が払われていない。

【0011】そこで、本発明者等は、先にR, G, B3色のインクジェットをそれぞれ生じさせる少なくとも1組の描画ヘッドと、インクジェットによる描画によってカラーフィルタが形成される基板を搭載して移動する移動手段と、基板と描画ヘッド間の相対変位を検出する変位検出手段と、描画ヘッドから吐出されたインクジェットの基板上における着弾位置を検出する手段とを用い、着弾位置の検出結果および相対変位検出結果に基づいて基板および描画ヘッド間の位置合わせを行なうカラーフィルタ製造装置および方法を案出し、特願平7-118940号(以下、先願という)として出願した。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この先願の装置および方法も、カラーフィルタを安定に生産していくには装置の性能等の点で未だ不十分であった。例えば、3色のインクジェットの着弾位置をいずれも良好に位置合わせすることは困難な場合があるという問題があった。

【0013】本発明の目的は、かかる問題点を改善するとともに、従来法の有する解像性等の特性を満足し、かつインクジェット方式の特性を生かした、安価で信頼性の高いカラーフィルタ製造装置および方法ならびにカラーフィルタを提供することにある。より具体的には、3色のインクジェットの着弾位置をより容易により良好に位置合わせすることを可能にすることにある。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するため、本発明の該カラーフィルタ製造装置は、R, G, B 3 色のインクジェットをそれぞれ吐出する少なくとも 1 組の描画へッドと、これら 3 色の描画へッドが取り付けられそれらのインクジェット吐出面および吐出口を相対位置合わせして固定されたヘッド取付治具と、が記れてりジェットによる基板を搭載された基板と前記 3 色の描画へッドとの間隔を描画へッドの位置に関して異なる少なくとも 3 か所で検出するギャップセンサと、前記インクジェットによる基準描画面に対して異なる少なくとも 3 か所で検出するギャップセンサと、前記インクジェットによる基準描画面に対して、かっド取付治具の高さおよび傾きを調整する手段と、前記移動手段に搭載された基板と描画へッドを位置合わせする位置合わせ手段とを具備することを特徴としている

【0015】本発明の好ましい実施例において、前記位置合わせ手段は、前記基板と描画ヘッド間の相対変位を検出する変位検出手段と前記描画ヘッドから吐出されたインクジェットの前記基板上における着弾位置を検出する手段とを備え、前記着弾位置の検出結果および相対変位の検出結果に基づいて前記基板および描画ヘッド間の

位置合わせを行なう。また、前記基板と描画ヘッドの相 対変位検出および位置合わせは6自由度方向のものであ

【0016】また、本発明のカラーフィルタの製造方法 は、R、G、B3色のインクジェットをそれぞれ吐出す る少なくとも1組の描画ヘッドと、これら3色の描画へ ッドが取り付けられ、それらのインクジェット吐出面お よび吐出口を相対位置合わせして固定されているヘッド 取付治具と、前記インクジェットによる描画によってカ ラーフィルタが形成される基板を搭載して移動する移動 手段と、前記基板と描画ヘッド間の位置合わせを行なう 位置合わせ手段とを具備するカラーフィルタ製造装置を 用い、前記基板を移動させながら前記描画ヘッドによっ て前記基板上に描画を行なうことによりカラーフィルタ を形成する際、基板への描画に先立って、厚みムラのな いダミー基板を前記移動手段に搭載し、前記ギャップセ ンサによって該ダミー基板と前記3色の描画へッドの隙 間を少なくとも異なる3か所で測定しながら、前記ヘッ ド取付治具の高さおよび傾きを調整して前記隙間を所定

[0017]

20 値に合わせることを特徴とする。

【作用】インクジェットを生じさせる手法として、例えば米国特許第4723129号および第4740796号に開示されているような、インクを核沸騰させて気泡を形成しインクを吐出させるいわゆるバブルジェット方式が知られている。そして、現在実現しているこの種の方式の描画ヘッドにおいてインクジェットの方向は、描画ヘッドのインクジェット吐出面の法線に対して約10度傾いている。そのため、基板と描画ヘッドの隙間が変化すれば、インクの着弾(付着)位置が変化する。

【0018】本発明によれば、3色の描画ヘッドを予めヘッド取付治具に取り付け、ヘッドアライメント用の装置上で3色の描画ヘッドのインクジェット吐出面および吐出口を位置合わせしておき、そのように位置合わせされた3色の描画ヘッドをヘッド取付治具ごとカラーフィルタ製造装置に搭載する。そして、厚みムラのないダミー基板を移動手段に搭載し、ギャップセンサによって該ダミー基板と前記3色の描画ヘッドの隙間を描画ヘッドの回りの少なくとも3か所で測定しながらこれらの隙間が一定の値となるようにヘッド取付治具の高さおよび傾きを調整する。

【0019】したがって、本発明によれば、3色の描画へッド相互の吐出口の位置関係は予め調整されており、カラーフィルタ製造装置への搭載後は、これらの3色の描画へッドとヘッド取付治具の全体を一まとめにして高さおよび傾きを調整するようにしたため、3色の描画へッドからのインクジェットの標準描画面への着弾位置を高精度に位置合わせすることが容易にでき、描画時は前記移動手段に基板を搭載した後、前記位置合わせ手段で該基板と描画へッドとを高精度に位置合わせすれば、高

5

精度の描画を行なうことができる。

[0020]

【実施例1】図1~図4は本発明の第1の実施例に係るカラーフィルタ製造装置を示す。図1は装置外観図(斜視図)、図2はステージ周辺の詳細図、図3は描画へッドおよび光学系の配置図、図4はインクの吐出のイメージを示す図である。

【0021】これらの図において、1は装置搭載用の定盤、2は定盤1を支持し、外部振動を遮断するための除振台、3は定盤1上に設けられ、大ストローク移動を行なうXYステージ、4はXYステージ3上に搭載された θ , Z-fルトアライメント合わせ用のZ-fルトステージ、5は θ , Z-fルトステージ4に搭載されたガラス基板、6 a \sim 6 c はそれぞれインクジェット複数個を一列に吐出する描画へッド、6はR, G, B 描画へッド、6 a \sim 6 c を相互に位置合わせし固定してなる描画へッド、7は基板5のX, Y, θ 方向のアライメント検出用光学系、8(8 a \sim 8 c)はギャップセンサとしてのZ検出用光学系、9は描画へッド6 a \sim 6 c が吐出するインクの着弾位置検出用の光学系である。

【0022】図5は上記描画ヘッドユニット6の上面図 である。R, G, Bの各描画ヘッド6a~6cはアーム 51a~51cに固定され、アーム51a~51cはそ れぞれ調整板52a~52cに固定され、調整板52a ~52cは固定ブロック53a,53cを介して相互に 固定されている。54aは描画ヘッド6bを基準とし て、描画ヘッド6 a の描画方向 (X方向) と直交する方 向 (Y方向) の位置合わせを行なうためのマイクロメー タ、55aは描画ヘッド6bを基準として、描画ヘッド 6 a の描画面(X-Y面)と平行な平面内の回転方向 (ω_Z) の位置合わせを行なうためのマイクロメータ、 56aは前記Y方向の位置合わせを行なった後描画へッ ド6bに対する描画ヘッド6aのY方向の相対位置を固 定するためのロックネジ、57aは前記ω7 方向の位置 合わせを行なった後描画ヘッド6bに対する描画ヘッド 6 a の ω Z 方向の相対位置を固定するためのロックネジ である。図5には図示されていないが、描画ヘッド6c に対しても描画ヘッド6 a 用のものと同様のマイクロメ ータやロックネジ等が用意されている。上述のアーム5 1 a ~ 5 1 c 、調整板 5 2 a ~ 5 2 c および固定ブロッ ク53a, 53c等は、本発明の特徴とするヘッド取付 治具を構成している。

【0023】上記の構成において、描画ヘッドユニット6は、ヘッド取付用の装置上で、描画ヘッド6a~6cのZ位置を合わせて、すなわち描画ヘッド6a~6cのインクジェット吐出面を同一平面に揃えて、図5の状態に組み立てられる。次いで、描画ヘッド6aについて、上述したマイクロメータ54aで描画ヘッド6bを基準とするY方向の位置合わせを行なってからロックネジ56aを締め、さらにマイクロメータ55aで描画ヘッド

6

6 b を基準とする ω_Z 方向の位置合わせを行なってからロックネジ5 7 a を締める。さらに描画ヘッド6 c についても同様に Y および ω_Z 方向の位置合わせおよびロックネジによる固定を行なう。これにより、描画ヘッド6 a \sim 6 c のインクジェット吐出面(Z 方向)および吐出口(Y および ω_Z 方向)が位置合わせされ描画ヘッド6 a \sim 6 c とヘッド取付治具とが一体化された描画ヘッドユニット6 が完成する。

【0024】この描画ヘッドユニット6は、図1〜図4に示すカラーフィルタ製造装置に搭載される。すなわち、ヘッドステージ10に取り付けられたヘッド搭載手段(不図示)に前記ヘッド取付治具を固定される。前記ヘッド搭載手段は、ヘッド取付治具の高さ(Z)およびチルト(ω_X , ω_Y)を調整する手段(不図示)を備えている。また、前記ギャップセンサ8a〜8cはヘッド取付治具に固定されている。ヘッドステージ10は4本の柱11により定盤1上にリジッドに取り付けられている。

【0025】図1~図4に示すカラーフィルタ製造装置において、装置の組立調整時等には厚みムラを極力押さえたダミーガラス基板(不図示)をXYステージ3上の θ , Z-チルトステージ4に搭載し、前記ギャップセンサ8a~8cにより、ダミーガラス基板と描画へッド6a~6cの隙間を測定し、これらの隙間が所定の値(例えば0.1mm)となるようにヘッド取付治具のダミーガラス基板に対する高さ(Z)およびチルト(ωX , ωY)を調整する。これにより、3色の描画ヘッド6a~6cをダミーガラス基板(基準描画面)に対して高精度に位置合わせすることができる。

【0026】続いて、アライメント検出系7で基板のX,Y, θ方向のアライメントを行ない、描画ヘッド6 a~6cで評価用のパターンを描画する。さらに、XYステージ3を移動し、着弾位置検出系9により着弾位置を測定する。このことによりアライメント検出系7の座標と描画ヘッド6a~6cの着弾位置の座標を正確に測定することができる。なお、この座標値は、別の基板を搭載しても変化しないので、装置組立時、描画ヘッド交換時等のシステムパラメータが変化した時に行なえば良い。着弾位置は、他の装置で測定しておき、この測定値がカラーフィルタ製造装置に再現されるようにしても良い

7

[0029]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、3 色の描画ヘッドを予めヘッド取付治具に取り付けて3色 の描画ヘッド間の相対位置合わせを行なっておき、これ

らの描画ヘッドとヘッド取付治具からなるユニットを単位としてカラーフィルタ製造装置への搭載および基準描画面に対する位置合わせを行なうようにしたため、3色のインクジェットの着弾位置を容易かつ高精度に位置合わせすることができ、解像性等の特性が良好なカラーフィルタを安価に信頼性よく製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施例に係る装置外観図(斜視図)である。

【図2】 図1の装置のステージ詳細図である。

【図3】 図1の装置のヘッド、光学系の配置図である。

【図4】 図1の装置のインクの吐出イメージである。

【図5】 図1の装置の描画ヘッドユニットの正面図である。

【符号の説明】

1:定盤、2:除振台、3:XYステージ、4:θ、Z ーチルトステージ、5:ガラス基板、6:描画ヘッドユニット、6a~6c:R,G,B描画ヘッド、7:アラ イメント検出(X,Y,θ検出)系、8a~8c:Z検 出系、9:着弾位置計測系、10:ヘッドステージ、1 1:柱、51a~51c:アーム、52a~52c:調整板、53a,53c:固定ブロック、54a,55 a:マイクロメータ、56a,57a:ロックネジ。

[図1]

